PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2003-233024

(43)Date of publication of application: 22.08.2003

(51)Int.Cl.

G02B 26/08

G02B 27/18

(21)Application number: 2002-035820

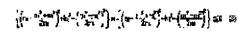
(71)Applicant: SONY CORP

(22)Date of filing:

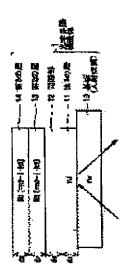
13.02.2002

(72)Inventor: ISHIKAWA HIROKAZU

(54) OPTICAL MULTILAYERED STRUCTURE, OPTICAL SWITCHING ELEMENT USING THE SAME, AND PICTURE DISPLAY DEVICE



(57) Abstract:



PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an optical multilayered structure which has less reflection boundary surfaces and has a simple arrangement. SOLUTION: An optical multilayered structure 1 has an arrangement where a first transparent layer 11 brought into contact with a substrate 10 used as an incidence medium, a gap part 12 which has a size allowing the occurrence of an interference phenomenon of light and can change the size, a second layer 13 being absorbent of light, and a third layer 14 being absorbent of light are arranged on the substrate 10 in order, and the optical multilayered structure modulates incident light from the substrate 10 side. They are set so as to satisfy formula (5)

where nS and n1 are refractive indexes of the substrate 10 and the first layer 11, respectively, and N2 (=n2-i k2, n2 is the refractive index, k2 is the attenuation coefficient, and i is the imaginary unit) and N3 (=n3-i k3, n3 is the refractive index, k3 is the attenuation coefficient, and i is the imaginary unit) are complex indexes of refraction of the second layer and the third layer, respectively.

Partial Translation of Reference 1

Jpn. Pat. Appln. KOKAI Publication No. 2003-233024

Filing No.: 2002-35820

Filing Date: February 13, 2002 Applicant: Sony Corporation

Priority: Not Claimed

KOKAI Date: August 22, 2003 Request for Examination: Not filed

Int.Cl.: G02B 26/08

27/18

Partial Translation A

(From page 2, column 1, lines 1 to 7)

[What is claimed is:]

[Claim 1]

An optical multilayer structure wherein:

a first layer, a gap section, a second layer and a third layer are provided on one surface of a substrate serving as a medium of incidence, the first layer being transparent, the gap section having a size enabling optical interference, the size being variable, and the third layer absorbing light; and

light incident from the substrate side is modulated.

Partial Translation B

(From page 4, column 6, line 35 to page 5, column 7, line 1)

[0021] FIGS. 1 and 2 illustrate a basic configuration of an optical multilayer structure 1 of an embodiment of the present invention. FIG. 1 illustrates a high reflective condition wherein the optical multilayer structure 1 has a gap section 12 (described later). FIG. 2 illustrates a low reflective condition wherein the optical multilayer structure 1 does not have the gap section 12. The optical multilayer structure is specifically utilized as an optical switching element. An image display apparatus is comprised of a plurality of the optical switching elements of one or two dimensional array.

[0022] The optical multilayer structure comprises a first layer 11, a gap section 12, a second layer 13, and a third layer 14, formed on one surface of a substrate 10 (serving as a medium of incidence) in the order mentioned. The first layer 11 contacts the substrate 10 and is transparent. The gap section 12 has a size enabling optical interference and the size is variable. The second layer 13 is formed on the first layer 11, with the gap section 12 interposed therebetween. The third layer 14 contacts the second layer 13 and absorbs light.

Partial Translation C

(From page 7, column 12, line 46 to page 8, column 13, line 9)

[0054] In this embodiment, incident light from the substrate side is modulated. Thus, the substrate 10 can serve as a transparent protective substrate of the optical multilayer structure 1. Consequently, another transparent protective substrate need not be provided on the substrate side (the side from which light enters), and less reflection surfaces need to be provided. If an image display apparatus is formed by use of the optical multilayer structure 1, a color filter can be formed directly on the other surface of the substrate 10, and a transparent protective substrate on which a color filter is formed need not be prepared as a different component. A protection member of the optical multilayer structure 1 on the side of the second layer 14 need not be a transparent substrate but can be opaque material, such as a cheep metal board, or any material, since light does not enter.

対応なし、英抄

(18)日本国特許庁 (J.P)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出屬公園番号 特第2003-233024 (P2003-233024A)

(43)公開日 平成15年8月22日(2003.8.22)

(51) Int.CL?

識別記号

ΡI

テーマコート (参考)

G02B 26/08

27/18

G 0 2 B 28/08 27/18 A 2H041

審査請求 未請求 請求項の数27 OL (全 14 頁)

(21) 出職番号

(22) 出画日

特顧2002-35820(P2002-35820)

平成14年2月13日(2002.2.13)

(71) 出層人 000002185

ソニー株式会社

東京都品川区北品川6丁目7番35号

(72) 発明者 石川 博一

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ

一株式会社内

(74)代理人 100098785

弁理士 藤島 詳一部

Fターム(参考) 25041 AA16 AB38 AB40 AC04 AC06

AZ02 AZ08

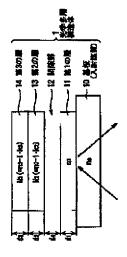
(54) 【発明の名称】 光学多層構造体、これを用いた光スイッチング素子および画像表示装置

(57)【要約】

【課題】 反射界面が少なく単純な構成の光学多層構造 体を提供する。

【解決手段】 光学多層構造体1は、入射媒質を兼ねる 基板10の上に、との基板10に接する、透明な第1の 層11、光の干渉現象を起こし得る大きさを有すると共 にその大きさを変化させることのできる間隙部12、光 の吸収のある第2の暦13 および光の吸収がある第3の 層14をこの順で配設した構成を有し、基板10側から の入射光を変調する。基板10の屈折率をn、、第1の 層11の屈折率をn、、第2の層の複素屈折率をN 」 (= n , - i · k , , n , は屈折率 , k , は消衰係 数. i は虚数単位)、第3の層の複素屈折率をN, (= n, -i·k, n, は屈折率, k, は消疫係数, iは 虚数単位)としたとき、次式の関係を満たすように設定 される。 【数5]

 $\left\{\left(n - \frac{m^2 + m^2}{2 T_R}\right)^2 + k_2^2 - \left(\frac{m^2 - m^2}{2 T_R}\right)^2\right\} \times \left\{\left(n - \frac{m^2 + m^2}{2 T_R}\right)^2 + k_2^2 - \left(\frac{m^2 - m^2}{2 T_R}\right)^2\right\} \le 0 \quad (5)$



*【請求項4】 前記第2の層が、光の吸収のある材料か らなることを特徴とする請求項 1 記載の光学多層構造

【請求項1】 入射媒質を兼ねる基板の一方の面に、透 明な第1の層、光の干渉現象を起こし得る大きさを有す ると共にその大きさが可変な間隙部、第2の層および光 の吸収のある第3の層を配設した構造を有し、前記基板 側から入射した光を変調することを特徴とする光学多層 構造体。

1

【請求項5】 前記第3の層が、光を透過しない程度の 厚さを有することを特徴とする請求項1記載の光学多層 橙杏体.

【請求項2】 前記基板の一方の面に、前記第1の層、 前記間隙部、前記第2の層および前記第3の層が、この 順で配設されていることを特徴とする請求項1記載の光 10 学多層構造体。

【請求項6】 前記基板の屈折率をn。、前記第1の層 の屈折率をn,、前記第2の層の複素屈折率をN, (= n, -i・k, , n, は屈折率, k, は消疫係数, iは 虚数単位)、前配第3の層の複素屈折率をN。(=n。 - i・k , , n , は屈折率, k , は消疫係数, i は虚数 単位)としたとき、次式(1)の関係を満たす 【数1】

【請求項3】 前記基板が、透明材料からなることを特 徴とする請求項 1 記載の光学多層構造体。

 $\times \left\{ \left(n_2 - \frac{m^2 + n_3^2}{2m} \right)^2 + k_2^2 - \left(\frac{m^2 - n_3^2}{2m} \right)^2 \right\}$

 $\left\{ \left(n_3 - \frac{m^2 + n_5^2}{2n_5} \right)^2 + k_5^2 - \left(\frac{m^2 - n_5^2}{2n_5} \right)^2 \right\}$

ととを特徴とする請求項1記載の光学多層構造体。

【請求項7】 前記第2の層の光学的特性を前記第3の

層の光学的特性に等しくして前記第2の層を省略してい ることを特徴とする請求項1記載の光学多層構造体。

【請求項8】 前記間隙部の光学的な大きさを変化させ 20 る駆動手段を有し、前記駆動手段によって前記間隙部の 大きさを変化させることにより、入射した光の反射、透 過若しくは吸収の量を変化させることを特徴とする請求 項1記載の光学多層構造体。

【請求項9】 前記駆動手段によって、前記間隙部の光 学的な大きさを、入/4の奇数倍と入/4の偶数倍(0 を含む)との間で、2値的あるいは連続的に変化させる ととで、入射光の反射、透過若しくは吸収の量を2値的 あるいは連続的に変化させることを特徴とする請求項8 配載の光学多層構造体。

《請求項Ⅰ0》 前記第1の層の光学的厚さが、A/4 (入は入射光の設計波長)以下であることを特徴とする 請求項1記載の光学多層構造体。

【請求項11】 前記第1の層、前記第2の層および前 記第3の層のうちの少なくとも一つは、互いに光学的特 性の異なる2以上の層により構成された複合層であると とを特徴とする請求項1記載の光学多層構造体。

【請求項12】 前記基板および前記第1の層のうちの 少なくとも一方と、前記第2の層および前記第3の層の うちの少なくとも一方とが、少なくとも一部に透明導電 40 腹を含み

前記駆動手段は、前記透明導電膜への電圧の印加によっ て発生した静電力により、前配間隙部の光学的な大きさ を変化させるものであることを特徴とする請求項8記載 の光学多層構造体。

【請求項13】 前記透明導電膜は、ITO. SnO. およびZn0のうちのいずれかからなることを特徴とす る請求項12記載の光学多層構造体。

【請求項14】 前記基板が、酸化ケイ素、ガラスおよ

する請求項1記載の光学多層構造体。

【請求項15】 前記第1の層が、酸化物および窒化物 のうちのいずれかからなることを特徴とする請求項1記 載の光学多層構造体。

【韻求項16】 前記第1の層が、窒化ケイ素、窒化ア ルミニウム、酸化チタン、酸化ニオブおよび酸化タンタ ルのうちいずれかからなることを特徴とする請求項15 記載の光学多層構造体。

【請求項17】 前記第2の層が、金属、酸化金属、窒 化金属、炭化物および半導体のうちいずれかからなるこ とを特徴とする請求項1記載の光学多層構造体。

【請求項18】 前記第3の層が、金属、酸化金属、窒 化金属、カーボン(C)、グラファイト、炭化物および 半導体のうちいずれかからなることを特徴とする請求項 30 1記載の光学多層構造体。

【請求項19】 前記基板が、酸化ケイ素、ガラスおよ びブラスチックのうちいずれかからなり、

前記第1の層が、酸化チタンからなり、

前記第2の層が、タングステン、ゲルマニウム、タンタ ルおよびチタンのうちいずれかからなり、

前記第3の層が、カーボンからなることを特徴とする論 求項 1 記載の光学多層構造体。

【請求項20】 前記基板が、酸化ケイ素、ガラスおよ びプラスチックのうちいずれかからなり、

前記第1の層が、酸化チタンからなり、

前記第2の層が省略されており、

前記第3の層がシリコン(Si)からなることを特徴と する請求項1記載の光学多層構造体。

【請求項21】 前記間隙部は、空気、または透明な気 体若しくは液体で満たされていることを特徴とする請求 項1記載の光学多層構造体。

【請求項22】 前記間隙部は、真空状態であることを 特徴とする請求項1記載の光学多層構造体。

【請求項23】 前記駆動手段は、磁力を用いて前記職 びブラスチックのうちのいずれかからなることを特徴と 50 隙部の光学的な大きさを変化させるものであることを特

徴とする請求項8記載の光学多層構造体。

【請求項24】 入射媒質を兼ねる基板の一方の面に、 透明な第1の層、光の干渉現象を起こし得る大きさを有 すると共にその大きさが可変な間隙部、第2の層および 光の吸収のある第3の層を配設した構造を有し、前記基 板側から入射した光を変調する光学多層構造体と、

前記間隙部の光学的な大きさを変化させるための駆動手 段とを備えたことを特徴とする光スイッチング素子。

【請求項25】 1次元または2次元に配列された複数 の光スイッチング素子に光を照射することで2次元画像 10 める必要があるなどの複雑さがある。 を表示する画像表示装置であって、

前記光スイッチング素子が、

入射媒質を兼ねる基板の一方の面に、透明な第1の層、 光の干渉現象を起こし得る大きさを有すると共にその大 きさが可変な間隙部、第2の層および光の吸収のある第 3の層を配設した構造を有し、前記基板側から入射した 光を変調する光学多層構造体と、

前記間隙部の光学的な大きさを変化させるための駆動手 段とを備えたことを特徴とする画像表示装置。

有することを特徴とする請求項25記載の画像表示装 置。

【請求項27】 前記基板の他方の面に、カラーフィル ターを有することを特徴とする請求項25記載の画像表 示技習.

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、入射光を反射、透 過若しくは吸収させる機能を有する光学多層構造体、と の光学多層構造体を用いた光スイッチング素子および画 30 しいが、その場合には基板の屈折率n,=4となる。可 像表示装置に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、映像情報の表示デバイスとしての ディスプレイの重要性が高まっており、このディスプレ イ用の素子として、更には、光通信、光記憶装置、光ブ リンタなどの素子として、高速で動作する光スイッチン グ素子 (ライトバルブ) の開発が要望されている。従 来、この種の素子としては、液晶を用いたもの。マイク ロミラーを用いたもの(DMD; Digtal Micro Miror D evice , ディジタルマイクロミラーデバイス、テキサス 40 装置を提案した(特願2000-219599明細 インスツルメンツ社の登録商標)、回折格子を用いたも の(GLV:Grating Light Valve,グレーティングライ トパルプ、SLM (シリコンライトマシン) 社製) 等が ある。

【0003】GLVは回折格子をMEMS(Micro Elec tro Mechanical Systems) 構造で作製し、静電力で10 nsの高速ライトスイッチング素子を実現している。D MDは同じくMEMS構造でミラーを動かすととにより スイッチングを行うものである。これらのデバイスを用 いてプロジェクタ等のディスプレイを実現できるもの

の、液晶とDMDは動作速度が遅いために、ライトバル ブとしてディスプレイを実現するためには2次元配列と しなければならず、構造が複雑となる。一方、GLVは 高速駆動型であるので、1次元アレイを走査するととで プロジェクションディスプレイを実現することができ る。

【0004】しかしながら、GLVは回折格子構造であ るので、1ピクセルに対して8つの素子を作り込んだ り、2方向に出た回折光を何らかの光学系で1つにまと

【0005】簡単な構成で実現できるものとしては、米 国特許公報5.589.974号や米国特許公報5.5 00,761号に開示されたものがある。このライトバ ルブは、基板(屈折率n、)の上に間隙部(ギャップ 層)を挟んで、屈折率が√n。の透光性の薄膜を設けた 構造を有している。この素子では、静電力を利用して薄 膜を駆動し、基板と薄膜との間の距離、すなわち、間隙 部の大きさを変化させることにより、光信号を選過ある いは反射させるものである。ととで、薄膜の屈折率は基 【請求項26】 前記基板の他方の面に、反射防止膜を 20 板の屈折率 n 。に対して、√n 。となっており、このよ うな関係を満たすととにより、高コントラストの光変調 を行うことができるとされている。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上述の ような構成の素子では、基板の屈折率n゚ が「4」など の大きな値でなければ、可視光領域においては実現する ととはできないという問題がある。すなわち、透光仲蔵 膜としては、構造体であることを考えると、窒化ケイ素 (Si, N,) (屈折率n=2, 0) などの材料が望ま 視光領域では、このような材料の選択肢は狭い。赤外線 等の通信用波長では、ゲルマニウム(Ge)(n= 4)、シリコン(Si)(n≒4)などを用いることに より実現可能である。

【0007】そこで、本出願人と同一出願人は、先に、 基板上に、光の吸収のある第1の層、光の干渉現象を超 とし得る大きさを有すると共にその大きさが可変な間酸 部、および第2の層を配設した構造を有する光学多層構 造体、これを用いた光スイッチング素子および画像表示 書)。この提案の光学多層構造体は、基板上に、光の吸 収のある第1の層、開隙部および第2の層をとの順で配 設した構成のものである。また、この光学多層構造体で は、基板の複素阻折率をN。 (= n; - i · k; n; は屈折率、k、は消疫係数、i は虚数単位)、第1の層 の複素屈折率をN, (=n, -i・k, , n, は屈折 率、k、は消疫係数)、第2の層の屈折率をn、、入射 媒質の屈折率を1.0としたとき、次式(2)の関係を 満たすように構成されている。

50 [0008]

【0009】上記提案の光学多層構造体によれば、2次 オ元の画像表示装置を構成するのに十分な高速応答が可能で、かつ原理的に単純な構造で光スイッチング素子を実現することができる。更に、光の反射と吸収とを切り替えることができるので、画像表示装置を実現する上で問題となる不要な光の処理を極めて簡単に行うことができる。したがって、この光スイッチング素子は直視・反射 10型の画像表示装置に好適に用いることができる。

5

【0010】ところで、上記提案の光学多層構造体は、光学多層構造体の第2の層の側(基板とは反対側)から入射する光に対して変調を行う。そのため、この光学多層構造体を用いて光スイッチング素子ないし画像表示装置を構成する場合には、基板上に形成された光学多層構造体を保護・封止するために光学多層構造体の第2の層の側に配置される付加基板として、透明なものを用いなければならない。カラー表示の場合には、この透明な付加基板にカラーフィルターなどを形成する。しかしながら、透明な付加基板を配数することによって反射界面が増えるので、それらの界面での反射が問題となり、反射防止膜を装着するなどの対策が必要となる翼がある。

$$\left\{ \left(n_2 - \frac{n_1^2 + n_2^2}{2n_3} \right)^2 + k_3^2 - \left(\frac{n_1^2 + n_3^2}{2n_3} \right)^2 \right\} \times \left\{ \left(n_2 - \frac{n_1^2 + n_3^2}{2n_3} \right)^2 + k_2^2 - \left(\frac{n_1^2 + n_3^2}{2n_3} \right)^2 \right\} \le 0 \quad (3)$$

【0015】本発明による光スイッチング素子は、入射 媒質を兼ねる基板の一方の面に、透明な第1の層、光の 干渉現象を起こし得る大きさを有すると共にその大きさ が可変な観瞭部、第2の層および光の吸収のある第3の 層を配設した構造を有し、基板側から入射した光を変調 30 する光学多層構造体と、間瞭部の光学的な大きさを変化 させるための駆動手段とを備えたものである。

【0016】本発明による画像表示装置は、1次元または2次元に配列された複数の光スイッチング素子に光を照射することで2次元画像を表示するものであって、光スイッチング素子が、入射媒質を兼ねる基板の一方の面に、透明な第1の層、光の干渉現象を起こし得る大きさを有すると共にその大きさが可変な間隙部、第2の層および光の吸収のある第3の層を配設した構造を有し、基板側から入射した光を変調する光学多層構造体と、間隙部の光学的な大きさを変化させるための駆動手段とを備えたものである。

【0017】本発明による光学多層構造体では、基板側から光を入射させ、間隙部の光学的な大きさを、「入/4」の(入は入射光の設計液長)の奇数倍と「入/4」の偶数倍(0を含む)との間で、2値的あるいは連続的に変化させると、入射光の反射、透過若しくは吸収の量が2値的あるいは連続的に変化する。

【0018】本発明による光スイッチング素子では、基 された第2の層13、および第2の層13に接する、光 板削から光を入射させ、駆動手段によって、光学多層構 50 の吸収のある第3の層14をこの順で配設して構成した

* {0011} 本発明はかかる問題点に鑑みてなされたもので、その目的は、反射界面が少なく単純な構成の光学 多層構造体、これを用いた光スイッチング素子および画像表示装置を提供することにある。

【0012】本発明による光学多層構造体は、入射媒質を兼ねる基板の一方の面に、透明な第1の層、光の干渉現象を起とし得る大きさを有すると共にその大きさが可変な間隙部、第2の層および光の吸収のある第3の層を配設した構造を有し、基板側から入射した光を変調するものである。

【0013】本発明による光学多層構造体では、基板の 屈折率を n。、第1の層の屈折率を n。、第2の層の複素屈折率を N。(= n。 i · k。 n。は屈折率、k。は消衰係数、i は虚数単位)、第3の層の複素屈折率を N。(= n。 - i · k。 n。は屈折率、k。は消衰係数、i は虚数単位)としたとき、次式(3)の関係を 満たすことが好ましい。

【0014】 【数3】

造体の間隙部の光学的な大きさを変化させることにより、入射光に対してスイッチング動作がなされる。

【0019】本発明による画像表示装置では、1次元あるいは2次元に配列された本発明の複数の光スイッチング素子に対して、基板側から光が照射されることによって、2次元画像が表示される。

[0020]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態につい て図面を参照して詳細に説明する。

【0021】図1および図2は、本発明の一実施の形態 に係る光学多層構造体1の基本的な構成を表すものであ る。図1は光学多層構造体1における後述の間瞭部12 が存在し、高反射時の状態、図2は光学多層構造体1の 間除部12がなく、低反射時の状態をそれぞれ示してい る。なお、この光学多層構造体1は具体的には例えば光 スイッチング素子として用いられ、この光スイッチング 素子を複数個1次元または2次元に配列することによ り、画像表示装置を構成することができる。

【0022】この光学多層構造体1は、入射媒質を兼ねる基板10の一方の面に、この基板10に接する、透明な第1の層11、光の干渉現象を起こし得る大きさを有すると共にその大きさを変化させることのできる間瞭部12、第1の層11と間瞭部12を挟んで反対側に形成された第2の層13、および第2の層13に接する、光の吸収のある第3の層14をこの順で配設して構成した

ものである。

【0023】基板10は、第1の暦11に入射する光の 入射媒質を兼ねており、例えば酸化ケイ素(Si 〇、)、ガラス、プラスチックなどの透明材料からなる ものとしてもよい。

7

【0024】第1の層11は、酸化物材料または窒化物 材料などの透明材料からなるものであり、例えば、酸化 チタン (TiO₂) (n₁=2,4), 窒化ケイ素 (S i_1N_*) $(n_1 = 2.0)$, 鉱化アルミニウム (A_1) N) (n, =2, 16), 酸化ニオブ (Nb, O,) $(n_1 = 2, 2)$, 酸化タンタル (Ta, O,) (n, Ta, O, O, Ta, O, O, Ta, O, Ta=2.1)などにより形成されている。

【0025】第1の層11の光学的な膜厚n,・d 」は、「λ/4」(λは入射光の設計波長)以下となっ ている。その理由は後述する。

【0026】間隙部12は、後述の駆動手段によって、 その光学的な大きさ(第1の層11と第2の層13との 間隔)が可変であるように設定されている。間隙部12 を埋める媒体は、透明であれば気体でも液体でもよい。 気体としては、例えば、空気(ナトリウムD線(58 9.3nm) に対する屈折率n。=1.0)、窒素 (N 2) (n。=1.0) など、液体としては、水(n。= 1. 333), 293-247n (n₀ = 1, 4~1, 7)、エチルアルコール(n_p = 1.3618)、グリ セリン (n。=1.4730)、ジョードメタン (n。 = 1. 737) などが挙げられる。なお、間隙部12を 真空状態とすることもできる。本実施の形態では、間隙 部12を空気で充填している。

【0027】間隙部12の光学的な大きさは、「入/4 の奇数倍」と「入/4の偶数倍(0を含む)」との間 で、2値的あるいは連続的に変化するものである。とれ により入射光の反射、透過若しくは吸収の量が2値的あ るいは連続的に変化する。なお、上記第1の層11およ び第2の暦13の膜厚の場合と同様に、入/4の倍数か ら多少ずれても、他の層の膜厚あるいは屈折率の多少の 変化で補完できるので、「 λ / 4 」の表現には、「ほぼ 入/4」の場合も含まれるものとする。

【0028】なお、本明細書中の表記での「A/4」は 厳密に「λ/4」でなくとも、これらの近傍の値でもよ い。これは、例えば、一方の層の光学膜厚が入/4より 40 厚くなった分、他方の層を薄くするなどして補完できる からであり、また、後述の式(4)から屈折率が多少ず れた場合でも、膜厚で調整可能な場合もあるからであ る。よって、本明細書においては、「λ/4」の表現に は「ほぼ入/4」の場合も含まれるものとする。

【0029】第2の層13は、タングステン(W), タ ンタル(Ta)、チタン(Ti)などの金属、窒化チタ ン (TiN) などの窒化金属, またはゲルマニウム (G e)などの半導体などの光の吸収のある材料からなるも は、後で図7を用いて説明する。

【0030】第3の層14は、酸化クロム (CrO) な どの酸化金属、窒化チタン(TiN)などの窒化金属、 カーボン(C)、グラファイト(黒鉛)、シリコンカー パイド(SiC)などの炭化物またはシリコン(Si) などの半導体などの、光の吸収のある材料からなるもの としてもよい。なお、第3の層14の材料例について は、後で図7を用いて説明する。

【0031】第3の暦14は、光を透過しない程度の膜 10 厚を有することが好ましい。低反射時において入射光が 第3の暦14によって吸収され、迷光などが発生する虞 がなくなるからである。

【0032】第1の層11、第2の層13および第3の 圏14は、互いに光学的特性の異なる2以上の層で構成 された複合層としてもよいが、との場合には複合層にお ける合成した光学的特性が単層の場合と同等な特性を有 するものとする必要がある。

【0033】次に、図3および図4、ならびに図5を参 照して、上記のような光学多層構造体 1 を実現するため 20 に上記した各層の光学定数が満たすべき条件について説 明する。以下の説明において用いる図3および図4は、 図1および図2に示した光学多層構造体1を表している が、説明をわかりやすくするために、入射媒質である基 板10を点線で表し、透明な第1の層11を最上層、光 の吸収のある第3の層14を最下層として、図1および 図2とは逆の順序で示している。

【0034】本実施の形態では、図3および図4に示し たように、n。の屈折率を持つ透明な基板10が入射媒 質であり、n、の屈折率を持つ透明な第1の層11が最 30 上層であり、第2の層13と最下層である第3の層14 とが光の吸収のある材料により形成されている。図3は 間職部12が存在し、高反射時の状態、図4は間職部1 2がなく、低反射時の状態をそれぞれ示している。

【0035】まず、図4に示した間隙部12がない場 合、すなわち低反射の場合には、第1の層11,第2の 層12および第3の層14のそれぞれの材料の光学アド ミッタンスを合成した合成光学アドミッタンスが、基板 10の光学アドミッタンス(n,と等値)となるように すれば、設計波長に対する反射率を0とすることができ る。ことで、光学アドミッタンスyは、複素屈折率N (= n - i · k、nは屈折率、kは消衰係数、i は虚数 単位)と値が同じである。例えば、空気のアドミッタン スはy(air)=1、n(air)=1、ガラスのアドミ ッタンスはy (glass) = 1.52, n (glass) = 1.52である。

【0038】すなわち、n,の屈折率を持つ透明な第1 の層 1 1 が、ダイアグラム上の(n, 0)の点 (基板 10の光学アドミッタンスであり、屈折率と等値)を通 る軌跡は、図5に示したように、実軸Re(Y)上でn のとしてもよい。なお、第2の層13の材料例について 50 , と n, */n, とを通り、中心Cが (n, *+

ns²)/2ns、半径rが(n₁²-ns²)/2n 。の円弧 a となる。ここで、第3の層 14の材料の光学 アドミッタンスy,(=複素屈折率N,(=n,-i・ k, 、n, は屈折率、k, は消衰係数、i は虚数単 位))が図5の円弧aの内側にあり、円弧aの外側に、 第2の層13の材料の光学アドミッタンスg,(≃複素 **屈折率N**。(= n, - i・k, 、n, は屈折率、k, は 消衰係数、 i は虚数単位))があるとすると、第3の層 14と第2の層13との合成光学アドミッタンスツ 11は、第3の層14の光学アドミッタンスタ、から出発 10 して、第2の層13の膜厚増加とともに緩やかなカーブ を描き、第2の暦13の光学アドミッタンスツ。に帰着 する。第3の層14の光学アドミッタンスg,と第2の 届13の光学アドミッタンスy』とは、第1の届11の 円弧 a を挟んで反対側に位置しているので、第3の層1 4と第2の層13との合成光学アドミッタンスッパは、 第1の層11の円弧aを必ず横切る。 こうして、第3の 層14と第2の層13との合成光学アドミッタンスy12 が第1の層11の円弧aとの交点における値となるよう に、第2の層13の膜厚を決めることができる。第3の 20 層14、第2の層13および第1の層11の合成光学ア ドミッタンスは、との交点から第1の層11の円弧 a に*

$$\left\{ \left(n_{2} - \frac{n_{1}^{2} + n_{2}^{2}}{2n_{3}} \right)^{2} + k_{3}^{2} - \left(\frac{n_{1}^{2} - n_{3}^{2}}{2n_{3}} \right)^{2} \right\} \times \left\{ \left(n_{2} - \frac{n_{1}^{2} + n_{3}^{2}}{2n_{3}} \right)^{2} + k_{2}^{2} - \left(\frac{n_{1}^{2} - n_{3}^{2}}{2n_{3}} \right)^{2} \right\} \le 0 \quad (4)$$

【0040】図5において、第1の層11の光学的な膜厚n,・d,は、(n,,0)から出発した第1の層11の円弧 aがちょうど半円となる(実軸上のn,*/n,)ときに、「λ/4」(入は入射光の設計波長)となる。第3の層14と第2の層13との合成光学アドミッタンスソ,2が第1の層11の円弧 aを横切るのはその半30円の途中であるから、第1の層11の光学的な膜厚n,・d,は、「λ/4」以下であることになる。

【0041】一方、図3に示したように、間隙部12がある場合には、第1の層11、間隙部12、第2の層13および第3の層14の合成光学アドミッタンスが、基板10の風折率n、に帰着せず、高反射となる。

【0042】すなわち、この光学多層構造体1では、第1の層11と第2の層I3との間の間瞭部12の間隔が「0」のときには反射防止膜となり、その間隔が設計波長に対し光学的にほぼれ/4の時には反射膜となる。つ40まり、間隔を「0」と「10/4」との間で可変とすることで、後述のように反射率を「0」と「70%」以上とに変えられる光スイッチング素子を実現することができる。間瞭部12の大きさを可変とするためには、基板10および第1の層11のうちの少なくとも一方と、第2の層13および第3の層14のうちの少なくとも一方と、第2の層13および第3の層14のうちの少なくとも一方とに、少なくとも一部に1TO(Indium-Tin Oxide)(n=2.0)などの透明導電膜を含め、静電気により駆動するなどの方法が考えられる。透明導電膜は、1TOの

*沿って移動する。したがって、第1の層11、第2の層 12および第3の層14の合成光学アドミッタンスが、 基板10の光学アドミッタンス(n, と等値)となるように第1の層11の膜厚を決めることができる。

10

【0037】とのように、第3の層14の光学アドミッタンスy、と第2の層13の光学アドミッタンスy、とが、第1の層11の光学的特性に依存する円弧aを挟んで反対側に位置するようにすれば、設計波長に対する反射率が0となるような膜厚の組合せが必ず存在する。第3の層14の光学アドミッタンスy、が円弧aの内側でもよいし外側でもよい。

【0038】かかる条件を満たすための、第3の層14 および第2の層13の光学定数の関係は、次式(4)のようになる。但し、別の光学定数を持った材料をどく薄く配することで第3の層14,第2の層13および第1の層11の合成光学アドミッタンスがn,に帰着することもあるので、式(4)を完全に満たさなくても良い場合もあることから、式(4)をほぼ満たす状態であればよい。

【0039】 【数4】

はか、酸化スズ(SnO。)(n=2.0)。酸化亜鉛(ZnO)(n=2.0)からなるものでもよい。 【0043】ところで、上記式(4)において、等号は、第2の暦13の光学的特性が第3の暦14の光学的特性に等しい場合、すなわち、図6に示したように、図3において第2の暦13が省略されている場合にあたる。図5の光学アドミッタンスダイアグラムでは、第3の暦14の光学アドミッタンスy,が第1の暦11の円弧a上にある場合に相当する。

【0044】このような光学多層構造体の材料の組み合わせとしては、上記のような制約を満足すればよく、その選定の自由度は広い。図7は、基板10がSiO、、第1の層11がTiO。である場合の第1の層11の光学アドミッタンスダイアグラムを表す曲線 a(図5の円弧 aに相当)と、第2の層13および第3の層14として用いうる各種材料の光学アドミッタンス(複素肥折率と等値)とを合わせて示したものである。図7の曲線(半円)aの内側の材料と外側の材料とを組み合せれば上述の光学多層構造体を実現する設計が見つかる。表1はその一例を表すものである。なお、表1における光学特性は、Palik の文献値を用いている(E.D. Palik, Handbook of Optical Constants of Solids, Academic Press)。

[0045]

【表1】

	材料	n (550nm)	k (550am)	膜厚 (nm)
第3の層	С	1.84	0.443	300以上
第2の層	w	3.24	2.49	10.3
阿陳部	空気	1	0	0/138
第1の層	TiO ₂	2.40	0	50.2
基板	SiO ₂	1.46	0	N/A

【0046】 ことでは、基板10としてクオーツ (Si して空気暦(n = 1.00)、第2の層13としてタン グステン層、第3の層14としてカーボン層を用いた。 カーボン層からなる第3の層14は、上述したように光 を透過しない程度の膜障を有するが、ことでは300m m以上としている。その理由は、第3の層14のカーボ ン層の膜厚が100mm、300mmおよび十分に厚い 場合のそれぞれについて低反射時の反射特性を調べたと とろ、図8に示したように、膜厚300ヵmでは十分に一 厚い場合とほぼ問程度の反射特性を示したからである。 なお、図8において、曲線8Aは膜厚100mmの場 合、曲線8Bは膜厚300nmの場合、そして曲線8C は膜厚が十分に厚い場合を表している。

【0047】図9は、とのような構成で、入射光の波長 (設計波長550nm)と反射率との関係をシミュレー ションした結果を表すものである。ここで、曲線9Aは 間隙部12(空気層)の光学膜厚が「0」(低反射 側)、曲線9Βは光学膜厚が「λ/4」(138 n m) (高反射側)の場合の特性をそれぞれ表している。図9*

*から分かるように、設計波長550nmで、低反射時は O.)、第1の層11としてTiO.層、間隙部12と 10 0%、高反射時は73%の反射特性を示している。ま た、図10は、低反射時の合成光学アドミッタンスダイ アグラムを示すもので、合成光学アドミッタンスが1. 46 (基板10の屈折率) に帰着していることが分か る。とれに対して、図11は、高反射時の合成光学アド ミッタンスダイアグラムを示すもので、合成光学アドミ ッタンスは基板10の屈折率に帰着していない。

> 【0048】なお、図7に示した各種材料の光学アドミ ッタンス (複素屈折率と等値) から分かるように、第2 の暦13の材料としては、タングステンの代わりにゲル 20 マニウム、タンタル、チタンなどを用いても同等の特性 を得ることができる。また、基板10はガラスまたはブ ラスチックでもよい。

【0049】表2は、上記式(4)において等号の場 合、すなわち、第2の暦13の光学的特性を第3の暦1 4の光学的特性に等しくして第2の層13を省略した構 成(図6参照)の一例を示したものである。

[0050]

【表2】

	材料	n (550mm)	k: (550nm)	護軍 (nm)
第3の層	Si	4.04	0,1	300以上
第2の階	省略	N/A	N/A	N/A
間隙部	空気	ı	0	0/138
第1の層	TiOz	2.40	0	59.0
基板	SiO ₂	1.46	0	N/A

【0051】 ここでは、基板10としてクオーツ (Si O.)、第1の層11としてTiO。層、間隙部12と して空気層(n=1.00)を用いたことは表1の例と してシリコン(Si)結晶を用いている。図7から分か るように、シリコン結晶の光学アドミッタンス(複素屈 折率と等値)は、ほぼ、TiO, 層からなる第1の層1 1の光学アドミッタンス曲線 a 上にある。

【0052】図12は、表2に示した構成で、入射光の 波長(設計波長550mm)と反射率との関係をシミュ レーションした結果を表すものである。ここで、曲線1 2 Aは間隙部12 (空気層)の光学膜厚が「0」(低反 射側)、曲線12Bは光学膜厚が「A/4」(138n

図12から分かるように、設計波長550mmで、低反 射時は0.2%、高反射時は76%の反射特性を示して

同様であるが、第2の層13を省略し、第3の層14と 40 [0053]本実施の形態の光学多層構造体1は、基板 10 側から光を入射させ、間隙部 12 の光学的な大きさ を、λ/4の奇数倍とλ/4の偶数倍(0を含む)との 間(例えば、「入/4」と「0」との間)で、2値的あ るいは連続的に変化させることによって、入射した光の 反射、透過若しくは吸収の量を変化させるものである。 【0054】このように本実施の形態では、基板10側 からの入射光に変調をかけるようにしたので、基板10 自体が光学多層構造体1の透明保護基板を兼ねることが できるようになる。したがって、基板10億(光が入射 m) (高反射側) の場合の特性をそれぞれ表している。 50 する側) に別の透明保護基板を配置する必要がなくな

り、反射界面が少なくて済む。さらに、この光学多層構造体1を用いて画像表示装置を形成する場合には、基板10の他方の面にカラーフィルターなどを直接作り込むことができ、カラーフィルターを形成した透明保護基板を別部品として用意する必要がなくなる。また、光学多層構造体1の第2の層14側の保護部材は、光が入射しないので透明基板である必要はなく、不透明な材料、例えば安価な金属板などでもよく、どのようなものを配置してもよい。

【0055】また、例えば550nmなどの可視光領域 10 においても、低反射時の反射率を殆ど0、高反射時の反射率を70%以上とすることができるので、1000対 1程度の高コントラストのディスプレイを実現可能である。しかも、構成が簡単であるので、GLVなどの回折格子構造やDMDなどの複雑な3次元構造よりも容易に作製することができる。また、GLVは1つのピクセルに6本の格子状のリボンが必要であるが、本実施の形態では1本で済むので、構成が簡単であり、かつ小さく作製することが可能である。また、可動部分の移動範囲も高々「入/2」であるため、10nsレベルの高速応答が可能になる。よって、ディスプレイ用途のライトバルブとして用いる場合には、後述のように1次元アレイの簡単な構成で実現することができる。

【0056】更に、本実施の形態の光学多層構造体1 は、間隙部を金属薄膜や反射層で挟んだ構造の狭帯域透 過フィルタ、すなわちファブリーペロータイプのものと は本質的に異なるものであるため、低反射帯の帯域福を 広くすることができる。よって、製作時の膜厚管理のマ ージンを比較的広くとることが可能であり、設計の自由 度が増す。

【0057】また、本実施の形態では、第2の暦13および第3の暦14の複素屈折率はある条件を満足する値であれば良いため、材料の選択の自由度が広くなる。さらに、第3の暦14は光を透過しない程度の厚さを有するので、低反射時において入射光は第3の層14に吸収され、迷光などが発生する心配はなくなる。

【0058】以上のように、本実施の形態の光学多層構造体1を用いることにより、高速で小型であり、しかも信頼性の向上した光スイッチング素子および画像表示装置を実現することができる。これらの詳細については後40述する。

【0059】〔駆動方法〕次に、上記光学多層構造体1 における間隙部12の大きさを変化させるための具体的 な手段について説明する。

【0060】図13は、静電気により光学多層構造体を駆動する例を示している。この光学多層構造体は、透明な基板10の上の第1の間11の両側にそれぞれ例えばアルミニウムからなる電極16a、16aを設けると共に、第2の層13および第3の層14を例えば窒化シリコン(Si, N,)からなる支持体15により支持し、

この支持体 1 5 の電極 1 6 a、 1 6 a に対向する位置に 電極 1 6 b、 1 6 b を形成したものである。

【0061】との光学多層構造体では、電極16a、16aおよび電極16b、16bへの電圧印加による電位差で生じた静電引力によって、間隙部12の光学膜厚を、例えば「 $\lambda/4$ 」と、「0」との間、あるいは「 $\lambda/4$ 」と「 $\lambda/2$ 」との間で2値的に切り替える。勿論、電極16a、16b、16bへの電圧印加を連続的に変化させることにより、間隙部12の大きさをある値の範囲で連続的に変化させ、入射した光の反射、若しくは透過あるいは吸収等の量を連続的(アナログ的)に変化させるようにすることもできる。

【0062】光学多層構造体を静電気で駆動するものとしては、その他、図14および図15に示した方法によってもよい。図14に示した光学多層構造体1は、透明な基板10の上の第1の層11上に例えば1下0(Indium-Tin Oxide)からなる透明導電膜17aを設けると共に、第2の層13および第3の層14を架橋構造に形成し、この第2の層13および第3の層14の外面に同じく1TOからなる透明導電膜17bを設けたものである

【0063】との光学多層構造体では、透明導電線17 a、17 b間への電圧印加による電位差で生じた静電引力によって、間隙部12の光学膜厚を切り替えるととができる。

【0064】図15に示した光学多層構造体では、図13の光学多層構造体の透明導電膜17aの代わりに、導電性のある第1の層11として例えば「TOなどの高屈折率透明導電膜を配したものである。

30 【0065】光学多層構造体の駆動は、このような静電気の他、トグル機構や圧電素子などのマイクロマシンを用いる方法、磁力を用いる方法や、形状配憶合金を用いる方法など、種々考えられる。図16(A)。(B)は磁力を用いて駆動する態様を示したものである。この光学多層構造体では、第3の層14の上に開孔部を有するコバルト(Co)などの磁性材料からなる磁性層40を設けると共に基板10の下部に電磁コイル41を設けたものであり、この電磁コイル41のオン・オフの切り替えにより、間隙部12の間隔を例えば「入/4」(図140(A))と「0」(図16(B))との間で切り替え、これにより反射率を変化させることができる。

【0066】 (光スイッチング装置)図17は、上紀光学多層構造体1を用いた光スイッチング装置1000株成を表すものである。光スイッチング装置100は、例えばガラスからなる基板110上に複数(図では4個)の光スイッチング素子100A~100Dを一次元アレイ状に配設したものである。なお、1次元に限らず、2次元に配列した構成としてもよい。この光スイッチング装置100では、基板110の一方の面の一方向(柔子50 配列方向)に沿って例えばITO膜111AとTiO。

膜111Bとが形成されている。このITO膜111A とTiO、膜111Bとが、上記実施の形態における第 1の層11に対応する。

15

【0067】基板1 I 0上には、I T O膜 1 1 1 Aおよ び窒化ケイ素膜111Bに対して直交する方向に、複数 本のタングステン(W)膜113が配設されている。タ ングステン膜113の外側には、カーボン (C) 膜11 4が配設されている。これらタングステン膜113およ びカーボン膜114が上記実施の形態の第2の層13お よび第3の層14にそれぞれ対応する。Ti〇、膜11 10 1 Bとタングステン膜 1 1 3 との間には、スイッチング 動作(オン・オフ)に応じてその大きさが変化する間隙 部112が設けられている。間隙部112の光学膜厚 は、入射光の波長 (λ = 5 5 0 n m) に対しては、例え ば「A/4」(138nm)と「0」との間で変化する ようになっている。

【0068】光スイッチング素子100A~100D は、例えば「TO膜111Aおよびタングステン膜11 3への電圧印加による電位差で生じた静電引力によっ て、間隙部12の光学膜厚を、例えば「λ/4」と 「0」との間で切り替える。図17では、光スイッチン グ素子100A, 100Cが間隙部12が「0」の状態 (すなわち、低反射状態)、光スイッチング素子100 B. 100Dが間隙部12が「λ/4」の状態(すなわ ち、高反射状態)を示している。なお、ITO膜111 Aおよびタングステン膜113と、電圧印加装置 (図示 せず)とにより、本発明の「駆動手段」が構成されてい る。

【0069】との光スイッチング装置100では、IT O膜111Aを接地して電位を0Vとし、第2の層13 30 に対応するタングステン膜113に例えば+12Vの電 圧を印加すると、その電位差によりITO膜111Aと タングステン膜113との間に静電引力が発生し、図1 7では光スイッチング素子100A.100Cのように 第1の層と第2の層とが密着し、間隙部112が「0」 の状態となる。との状態では、入射光P。は上記多階構 造体を透過し、更に第3の層14に対応するカーボン膜 114に吸収される。

【0070】次に、第2の層側の透明導電膜106を接 膜106との間の静電引力がなくなり、図14では光ス イッチング素子100B, 100Dのように第1の層と 第2の層との間が離間して、間隙部12が「λ/4」の 状態となる。この状態では、入射光P、は反射され、反 射光P、となる。

【0071】このようにして、本実施の形態では、光ス イッチング素子100A~100D各々において、入射 光P、を静電力により間隙部を2値に切り替えることに よって、反射光がない状態と反射光P。が発生する状態 のように間除部の大きさを連続的に変化させることによ り、入射光P。を反射がない状態から反射光P。が発生 する状態に連続的に切り替えることも可能である。

【0072】とれち光スイッチング素子100A~10 0 Dでは、可動部分の動かなくてはならない距離が、大 きくても入射光の「 $\lambda / 2$ (あるいは $\lambda / 4$)」程度で あるため、応答速度が10 n s 程度に十分高速である。 よって、一次元アレイ構造で表示用のライトパルブを実 現することができる。

【0073】加えて、本実施の形態では、1ピクセルに 複数の光スイッチング素子を割り当てれば、それぞれ独 立に駆動可能であるため、面像表示装置として画像表示 の階調表示を行う場合に、時分割による方法だけではな く、面積による階調表示も可能である。

【0074】〔画像表示装置〕図18は、上記光スイッ チング装置100を用いた画像表示装置の一例として、 プロジェクションディスプレイの構成を表すものであ る。ここでは、光スイッチング素子100A~100D からの反射光P、を画像表示に使用する例について説明 20 する。

【0075】とのプロジェクションディスプレイは、赤 (R), 緑(G), 青(B) 各色のレーザからなる光源 200a, 200b, 200cと、各光源に対応して設 けられた光スイッチング素子アレイ201a、201 b. 201c、ダイクロイックミラー202a. 202 b、202c、プロジェクションレンズ203、1軸ス キャナとしてのガルバノミラー204および投射スクリ ーン205を備えている。なお、3原色は、赤、緑、青 の他、シアン、マゼンダ、イエローとしてもよい。スイ ッチング素子アレイ201a, 201b, 201cはそ れぞれ、上記スイッチング素子を紙面に対して垂直な方 向に複数、必要画素数分、例えば1000個を1次元に 配列したものであり、これによりライトバルブを構成し ている。

【0076】とのプロジェクションディスプレイでは、 RGB各色の光源200a、200b、200cから出 た光は、それぞれ光スイッチング素子アレイ201a. 201b, 201cに入射される。なお、この入射角は 偏光の影響がでないように、なるべく0に近くし、垂直 地させ電位をOVにすると、TaN、膜102とITO 40 に入射させるようにすることが好ましい。各光スイッチ ング素子からの反射光P。は、ダイクロイックミラー2 02a, 202b, 202cによりプロジェクションレ ンズ203に集光される。プロジェクションレンズ20 3で集光された光は、ガルバノミラー204によりスキ ャンされ、投射スクリーン205上に2次元の画像とし て投影される。

【0077】このように、このプロジェクションディス プレイでは、複数個の光スイッチング素子を 1 次元に配 列し、RGBの光をそれぞれ照射し、スイッチング後の の2値に切り替えて取り出すことができる。勿論、前述 50 光を1輪スキャナにより走査することによって、2次元 画像を表示するととができる。

【0078】また、本実施の形態では、低反射時の反射 率を0.1%以下、高反射時の反射率を70%以上とす ることができるので、1、000対1程度の高コントラ ストの表示を行うことができると共に、素子に対して光 が垂直に入射する位置で特性を出すことができるので、 光学系を組む際に、偏光等を考慮にする必要がなく、機 成が簡単である。

17

【0079】以上実施の形態を挙げて本発明を説明した が、本発明は上記実施の形態および変形例に限定される 10 ものではなく、種々変形可能である。例えば、上記実施 の形態では、光源としてレーザを用いて一次元アレイ状 のライトバルブを走査する構成のディスプレイについて 説明したが、図19に示したように、二次元状に配列さ れた光スイッチング装置206に白色光源207からの 光を照射して投射スクリーン208に画像の表示を行う 構成とするとともできる。

【0080】また、上記実施の形態では、基板としてガ ラス基板を用いる例について説明したが、図20に示し たように、例えば厚さ2mm以内の柔軟性を有する(フ 20 レキシブルな) 基板209を用いたペーパー状のディス プレイとし、直視により画像を見ることができるように してもよい。

【0081】また、上記実施の形態では、RGB各色の 光源を用いるようにしたが、カラーフィルターを用いて カラー表示を行うようにしてもよい。その場合には、図 21に示したように、基板110の一方の面110Aに 上記光学多層構造体を用いた光スイッチング素子【〇〇 を配設し、他方の面110Bにカラーフィルター120 R. 120G、120Bを形成するようにすることがで 30 位))とするとき、これらが特定の条件を満たすように きる。また、この基板110の他方の面110Bに、反 射防止膜130を設けることも可能である。

【0082】更に、上記実施の形態では、本発明の光学 多層構造体をディスプレイに用いた例について説明した が、例えば光ブリンタに用いて感光性ドラムへの画像の 描きこみをする等、ディスプレイ以外の光プリンタなど の各種デバイスにも適用することも可能である。

[0083]

【発明の効果】以上説明したように、請求項1ないし請 求項23のいずれか1項に配載の光学多層構造体および 40 る。 請求項24記載の光スイッチング素子によれば、基板側 からの入射光に変調をかけるようにしたので、基板自体 が光学多層構造体の透明保護基板を兼ねることができる ようになる。したがって、基板側(光が入射する側)に 別の透明保護基板を配置する必要がなくなり、反射界面 が少なくて済む。さらに、この光学多層構造体または光 スイッチング業子を用いて画像表示装置を形成する場合 には、基板の他方の面にカラーフィルターなどを直接作 り込むことができ、カラーフィルターを形成した透明保 護基板を別部品として用意する必要がなくなる。また、

光学多層構造体の第2の層側の保護部材は、光が入射し ないので透明基板である必要はなく、不透明な材料、例 えば安価な金属板などでもよく、どのようなものを配置 してもよい。

【0084】しかも、構成が簡単であるので、GLVな どの回折格子構造やDMDなどの複雑な3次元構造より も容易に作製することができる。また、GLVは1つの ビクセルに6本の格子状のリボンが必要であるが、上記 の光学多層構造体では1本で済むので、構成が簡単であ り、かつ小さく作製することが可能である。また、間隙 部をなくして基板上に第1の層、第2の層および第3の **潛をこの順で接する構造とすることにより、反射防止膜** として利用することができる。

【0085】更に、上記の光学多層構造体は、間隙部を 金属薄膜や反射層で挟んだ構造の狭帯域透過フィルタ、 すなわちファブリーペロータイプのものとは本質的に異 なるものであるため、低反射帯の帯域幅を広くすること ができる。よって、製作時の膜障管理のマージンを比較 的広くとることが可能であり、設計の自由度が増す。

【0086】特に、請求項5記載の光学多層構造体によ れば、第3の層は光を透過しない程度の厚さを有するの で、低反射時において入射光は第3の層に吸収され、迷 光などが発生する心配はなくなる。

【0087】また、特に、請求項6記載の光学多層構造 体によれば、基板の屈折率をn、、第1の層の屈折率を n, , 第2の隘の複素屈折率をN, (=n, -i・ k。、n。は屈折率、k。は消衰係数、i は虚数単 位)、第3の層の複素屈折率をN, (=n, -i・ k,、n,は屈折率、k,は消疫係数、i は虚数単 構成したので、閻隙部の大きさを変化させることによ り、入射した光の反射、透過若しくは吸収の量を変化さ せることができ、簡単な構成で、特に例えば550nm などの可視光領域においても、低反射時の反射率を殆ど 0、高反射時の反射率を70%以上とすることができ る。したがって、1000対1程度の高コントラストの ディスプレイを実現可能である。さらに、第2の層およ び第3の層の複素屈折率N,,N,はある条件を満足す る値であれば良いため、材料の選択の自由度が広くな

【0088】特に、請求項7記載の光学多層構造体によ れば、第2の層の光学的特性を第3の層の光学的特性に 等しくして第2の層を省略しているので、構造や製造ブ ロセスをより簡単にすることができる。

【0088】加えて、特に、請求項9記載の光学多層構 造体によれば、間隙部の光学的な大きさを入/4の奇数 倍と入/4の偶数倍との間で2値的あるいは連続的に変 化させるようにしたので、可動部分の移動範囲も高々

「A/2」となり、10nsレベルの高速応答が可能に 50 なる。よって、ディスプレイ用途のライトバルブとして

用いる場合には、1次元アレイの簡単な構成で実現する ことができる.

【0090】また、請求項25ないし請求項27のいず れか1項に記載の画像表示装置によれば、本発明の光ス イッチング素子を1次元または2次元に配列し、この1 次元または2次元アレイ構造の光スイッチング装置を用 いて画像表示を行うようにしたので、高コントラストの 表示を行うことができると共に、素子に対して光が垂直 に入射する位置で特性を出すことができるので、光学系 を組み立てる場合に、個光等を考慮にする必要がなく、 構成が簡単となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施の形態に係る光学多層構造体の 間隙部が「入/4」のときの構成を表す断面図である。 【図2】図1に示した光学多層構造体の間隙部が「0」 のときの構成を表す断面図である。

【図3】図1に示した光学多層構造体を、入射媒質であ る基板を点線で表し、第1の層を最上層、第3の層を最 下層として、図1とは逆の順序で示した断面図である。

【図4】図2に示した光学多層構造体を、入射媒質であ 20 するための断面図である。 る基板を点線で表し、第1の層を最上層、第3の層を最 下層として、図2とは逆の順序で示した断面図である。

【図5】光学アドミッタンスダイアグラム上で、 n、の 屈折率を持つ透明な第1の層が、ダイアグラム上の(n 3,0)の点(基板の光学アドミッタンス)を通る軌跡 を表す図である。

【図6】図1の光学多層構造体の変形例を表す図であ る。

【図7】図1に示した光学多層構造体において基板をS iO, . 第1の層をTiO, により形成した場合の第1 30 の層、12, 112…間隙部、13…第2の層、14… の層の光学アドミッタンスダイアグラムと、の各種材料 の光学アドミッタンスとを合わせて示す図である。

*【図8】表1に示した構成例について、第3の層のカー ボン層の膜厚を100nm、300nmおよび十分に厚 い場合に変化させた場合のそれぞれについて低反射時の 反射特性を表す図である。

20

【図9】表1に示した構成例の反射特性を表す図であ る。

【図10】図9の例の低反射時の光学アドミッタンスを 表す図である。

【図11】図9の例の高反射時の光学アドミッタンスを 10 表す図である。

【図12】表2に示した構成例の反射特性を表す図であ 3.

【図13】光学多層構造体の静電気による駆動方法を説 明するための断面図である。

【図14】光学多層構造体の静電気による他の駆動方法 を説明するための断面図である。

【図15】光学多階構造体の静電気による更に他の駆動 方法を説明するための断面図である。

【図16】光学多層構造体の磁気による駆動方法を説明

【図17】光スイッチング装置の一例の構成を表す図で ある。

【図18】ディスプレイの一例の構成を表す図である。

【図19】ディスプレイの他の例を表す図である。

【図20】ペーパー状ディスプレイの構成図である。

【図21】ディスプレイのさらに他の例を表す図であ

【符号の説明】

I…光学多層構造体、10,110…基板、11…第1 第2の層、100…光スイッチング装置

